Реєстраційна картка НДДКР

Державний реєстраційний номер: 0119U102906

Відкрита

Дата реєстрації: 23-08-2019

Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця НДР або безкоштовно)

КПКВК:

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування

7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік	Фінансування

2. Замовник

Назва організації: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070921

Адреса: проспект Перемоги, 37, м. Київ, Київська обл., 03056, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380442367989

Телефон: 380442044862

E-mail: mail@kpi.ua

WWW: https://kpi.ua/

3. Виконавець

Назва організації: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070921

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: проспект Перемоги, 37, м. Київ, Київська обл., 03056, Україна

Телефон: 380442367989

Телефон: 380442044862

E-mail: mail@kpi.ua

WWW: https://kpi.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розсіяння світла на шорсткій поверхні кварцу

Назва роботи (англ)

Light scattering by the rough quartz surface

Мета роботи (укр)

Визначення конфігурації електромагнітного випромінювання вздовж границі поділу кварц-середовище, яка забезпечує необхідні умови для селективного травлення поверхні кварцу в областях виступів. Визначення умов забезпечення необхідного контрасту електричного поля на поверхні зразка кварцу, які повязані з формою поверхні зразка та параметрами її шорсткості, а також довжиною хвилі електромагнітного випромінювання.

Мета роботи (англ)

Determination of the configuration of electromagnetic radiation along the quartz-interface, which provides the necessary conditions for the selective etching of the quartz surface in the protrusion regions. Determination of conditions for providing the required contrast of the electric field on the sample surface of the quartz, which is related to the shape of the sample surface and its roughness parameters, as well as the wavelength of electromagnetic radiation.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: Технологічні процеси мікро та наноелектроніки

6. Етапи виконання

Номер	Початок	Закінчення	Звітний документ	Назва етапу
1	09.2019	03.2020	Остаточний звіт	Умови забезпечення необхідного контрасту електричного поля для полірування поверхні кварцу

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 27.35.33, 29.41.03, 47.13.07

Індекс УДК: 517.958:537.8;517.958:535, , 621.37-973.002

8. Заключні відомості

Керівник організації:

Татарчук Дмитро Дмитрович (к. т. н., доц.)

Керівники роботи:

Каневський Василь Іванович (к. т. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Каневський Василь Іванович (Тел.: +38 (099) 738-77-75)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.